

第 38 回分析電子顕微鏡討論会のお知らせ

主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会 分析電子顕微鏡分科会
協賛：依頼予定

日 程：2023 年 11 月 30 日（木）、12 月 1 日（金）

方 法：オンラインでの開催（Zoom を予定）

定 員：150 名

参加費（予稿集代含む）：顕微鏡学会員及び協賛学会員(個人会員) 2,500 円、 非会員 3,000 円、学生 1,500 円

内 容：分析電子顕微鏡に関わるチュートリアルと研究トピックスについて講演が行われます。「チュートリアル」では、分析電顕の基軸となる EDS、EELS、STEM の基礎について詳しい講演がなされます。初日のトピックセッションでは、「マルチプローブによる構造解析の最前線」と題して、各種プローブを用いた解析の新展開を紹介しします。二日目の午前には、「試料作製」のセッションで、最近進展の著しい FIB（集束イオンビーム装置）による自動化とソフトマテリアルの試料作製について紹介しします。また、午後には「元素分析の新展開」について、最近の研究例を紹介しします。分析電顕に関わる活発な討論の機会となりますよう奮ってご参加ください。また今年度から、一般講演の募集を再開することに致しました。発表時間は質疑応答を含めて 15 分の予定です。こちらについても是非ご発表を検討いただければと思います。

申込方法：追って Web サイト (<https://sites.google.com/view/bunseki-denken38>) に掲載いたします。

発表申込（一般講演）締切：2023 年 10 月 15 日（日） （予定）

参加申込締切：2023 年 11 月 22 日（水） （予定）

連絡先：〒860-8555 熊本県熊本市中央区黒髪 2 丁目 3 9 番 1 号 工学部研究棟 I 908 号室

熊本大学 半導体・デジタル研究教育機構

分析電子顕微鏡討論会事務局 佐藤 幸生

Tel: 096-342-2281 E-mail: sato-yukio@kumamoto-u.ac.jp

第 38 回分析電子顕微鏡討論会プログラム（案）

（2023 年 6 月 19 日現在）

11 月 30 日(木) 9:30-15:50

1. チュートリアル

- 9:30- EDS の基礎 山本知一（九州大学）
10:10- EELS の基礎 斎藤光（九州大学）
10:50- 走査透過電子顕微鏡法 石川亮（東京大学）
11:30- Q&A（20 分）

— 昼休み（11:50-13:30） —

2. 一般講演 1（発表時間 15 分（含む質疑応答））

- 13:30- 講演募集予定

3. トピック 1 「マルチプローブによる構造解析の最前線」

- 14:00- ブラッグコヒーレント X 線回折イメージング法によるナノ結晶非破壊 3 次元イメージング
大和田謙二、押目典宏、菅原健人、島田歩、町田晃彦、綿貫徹（量子科学技術研究開発機構）、黒岩芳弘（広島大学）
14:30- ミュオン顕微鏡に関する講演（仮） 永谷幸則（量子科学技術研究開発機構）
15:00- 電子波による電磁場分析の最前線 谷垣俊明（日立製作所）
15:30- Q&A（20 分）

12 月 1 日(金) 10:00-15:50

1. 試料作製

- 10:00- FIB の自動化 ～近年の現状と課題について～ 完山 正林（サーモフィッシャーサイエンティフィック）
10:30- 半導体製造ラインにおける TEM 解析の自動化と SEMI 規格 大西毅、富松聡（日立ハイテク）
11:00- ソフトマテリアルの試料作製方法 広瀬治子（日本電子）
11:30- Q&A（20 分）

— 昼休み（11:50-13:30） —

2. 一般講演 2（発表時間 15 分（含む質疑応答））

- 13:30- 講演募集予定

3. トピック 2 「元素分析の新展開」

- 14:00- 新型プラズマ FIB-SEM の特徴と元素分析事例 宗兼正直（サーモフィッシャーサイエンティフィック）
14:30- SEM-EDS を用いたナノカーボン材料の高空間分解元素イメージング評価技術 中島秀朗（産業技術総合研究所）
15:00- 強度差組成決定法によって広がるマイクロスケールでの Li 分布評価の可能性
川畑正伸（アメテック株式会社 エダックス事業部）
15:30- Q&A（20 分）